

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和2年2月20日(2020.2.20)

【公開番号】特開2018-195725(P2018-195725A)

【公開日】平成30年12月6日(2018.12.6)

【年通号数】公開・登録公報2018-047

【出願番号】特願2017-98913(P2017-98913)

【国際特許分類】

H 01 L 21/66 (2006.01)

G 01 R 31/26 (2020.01)

G 01 K 11/12 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/66 T

G 01 R 31/26 Z

G 01 K 11/12 B

【手続補正書】

【提出日】令和1年12月25日(2019.12.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

前記検査装置を複数有し、前記搬送装置は、前記基板および前記温度測定基板を各検査装置のステージに搬送することを特徴とする請求項1に記載の検査システム。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項14

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項14】

前記検査システムは、前記検査装置を複数有し、前記搬送装置は、前記温度測定基板を各検査装置のステージに搬送して前記温度測定基板の温度を測定することを特徴とする請求項13に記載の検査システムにおける温度測定方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項16

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項16】

前記温度測定基板は、前記温度測定部材が基材上に形成されてなることを特徴とする請求項13から請求項15のいずれか1項に記載の検査システムにおける温度測定方法。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

上記第1および第2の観点において、前記検査装置を複数有し、前記搬送装置は、前記基板および前記温度測定基板を各検査装置のステージに搬送するようにしてよい。